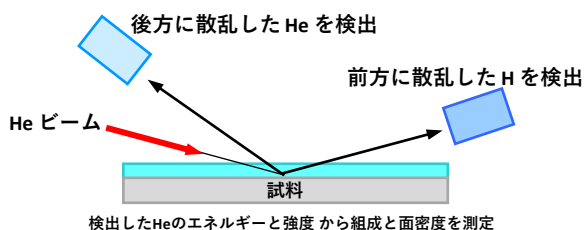


薄膜の密度評価

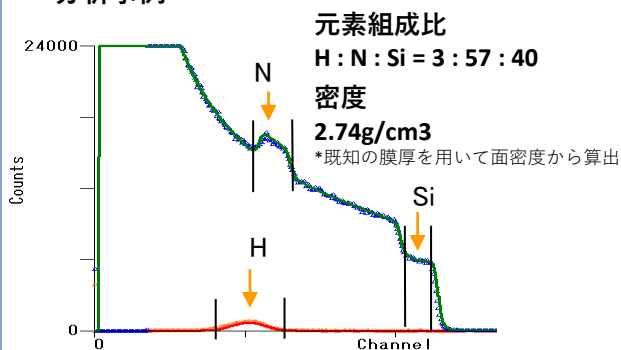
Film Density Analysis

RBS/ERDAによる膜密度評価

<測定模式図>



<分析事例>

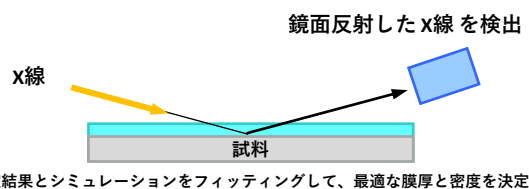


<実績>

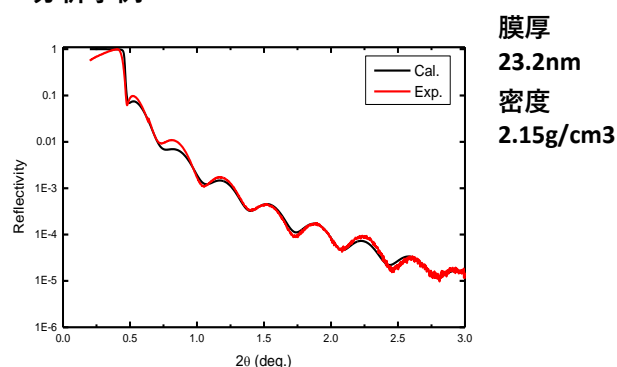
・ low-k膜 ・ high-k膜 ・ DLC膜 ・ 金属酸化膜

XRRによる膜密度評価

<測定模式図>



<分析事例>



<実績>

・ low-k膜 ・ high-k膜 ・ DLC膜 ・ 積層膜

膜密度評価手法の比較

RBS/ERDA

XRR

特徴 Characteristics

組成を同時に評価可能

非破壊分析
膜厚を同時に取得可能

測定可能膜厚 Thickness

30nm~300nm

0.5nm~300nm

推奨検体サイズ Size

15mm~30mm□

30mm□以上

その他 Other

密度算出には膜厚が必要



Ion Technology Center Co.,Ltd
株式会社 イオンテクノセンター

<お問合せ先>

HP : <https://iontc.co.jp/>

TEL: 072-859-6601

Email : info@iontc.co.jp

<サンプルご送付先>

〒573-0128 大阪府枚方市津田山手二丁目8番1号